

# 共同利用機器講習会

## 三次元光学プロファイラー (3次元表面構造解析装置) 〈ZYGO NEWVIEW 7300〉

### 【装置概要】

鏡面加工や微細加工等のプロセスが施された表面や物体表面の三次元形状を走査型白色光干渉技術により 0.1 ナノメートルの垂直分解能で高速測定し、測定面の性状を多彩なパラメータにより定量的に解析評価する。

【日時】平成 29年 5月 2日 (火) ①10:00~11:30 ②13:30~15:00  
③15:30~17:00 (3回とも同内容です)

【場所】理学部コラボレーション棟、機器解析室1 (1階101号室)

【講習の概要】装置の概説と基本操作方法

### 【申込方法】

ご希望の時間帯(①~③)とともに下記までご連絡下さい。なお、ご希望多数の場合はスケジュール調整させて頂く場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。

【申込問合先】工学部 大橋一仁 (内線:津島8041)

k-ohashi@okayama-u.ac.jp

※本装置の利用には、説明会の受講が必要となります。

自然生命科学研究支援センター 分析計測分野より  
ホームページでもご案内しておりますので、どうぞご覧下さい。  
URL:<http://dia.kikibun.okayama-u.ac.jp/>